

SALANG

赛慕朗

赛慕朗 SLX SLX-1000 系列 超多维集成显微分析系统

SALANG SLX Ultra-dimensional Integrated Microanalysis System



从常规观察到专业分析
一套平台满足更多需求

* 赛慕朗 SLX 超多维集成显微分析系统
或称 SLX 全域集成显微系统





超景深

典型应用领域：

精密模具 & 刀具行业，3C 电子 & 半导体封装；
汽车零部件 & 压铸件，科研与教学样品观察；
钟表 / 小五金 / 精密冲压件；
广泛用于模具、刀具、电子封装、汽车零部件、注塑件的外观缺陷与尺寸检测。

多功能集成平台

| 覆盖多种观察方式与分析应用 All IN ONE

环境规格

参数	规格
环境温度	10℃~40℃
相对湿度	最大85%
工作大气压	76kPa-106kPa
储存温度	-20℃~55℃
储存湿度	最大湿度85%RH 无结露

电箱规格

参数	规格
主机输入	12V 2.1A
电箱输入	5V 2A

主要技术参数

参数	规格
灯泡功率	10W/5V
灯泡寿命	6万小时(光衰50%时约2.5万小时)
工作电压	直流24V
目镜倍率	10倍 15倍 20倍(可选)
物镜倍率	2.5倍(可选) 5倍 10倍 20倍 50倍 100倍(可选)
观察与方式	相差(可选) 明场 暗场 偏光 相差 红外 荧光(可选) 核动力 MIX功能 微分干涉(DIC)

新搭建

测量区域 传统产品的20倍

保证低倍率镜头的精度

实现传统显微镜难以达到的大范围微小形状测量。

新原理

测量时间 最快1秒

Focus Variation

最快1秒拍照。

新算法

全自动检测

RPAll/AI 扫描

无需测量设定，放置后仅按一键即可精准测量微小形状。

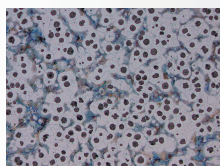


多维融境 · 精析微观万象

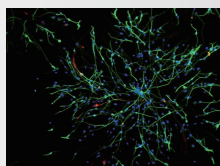
全域融合、多技术集成、全能拓展、行业通用

多观察方式集成 多领域应用覆盖 一套平台承担更多任务

SLX全域集成显微系统以平台化集成为核心，可围绕相差、明场、暗场、微分干涉、偏光、荧光、金相分析及三维测量等多种观察与分析需求进行扩展，在同一系统中实现从常规观察到深度分析的多场景应用。相比为不同任务分别配置设备，一套平台即可承载更多检测与研究工作，帮助用户提升设备利用率并优化整体投入。



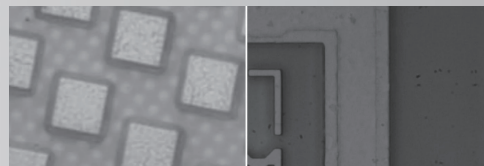
金相组织



荧光图



微分干涉/DIC 图



半导体/电子样品图



生命科学镜头： 追求极致分辨率、荧光弱光成像、穿透透明样本

半导体镜头： 追求精密测量、长工作距离、表面反射成像、抗污染、远心无畸变

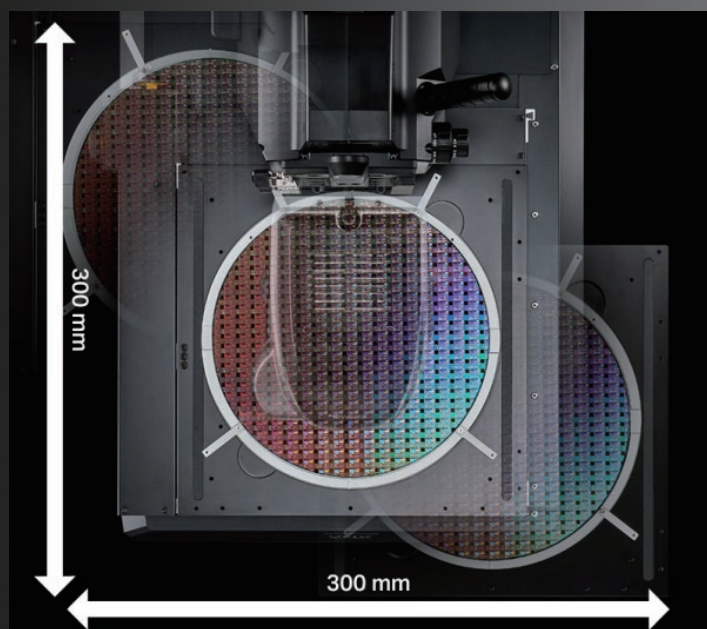
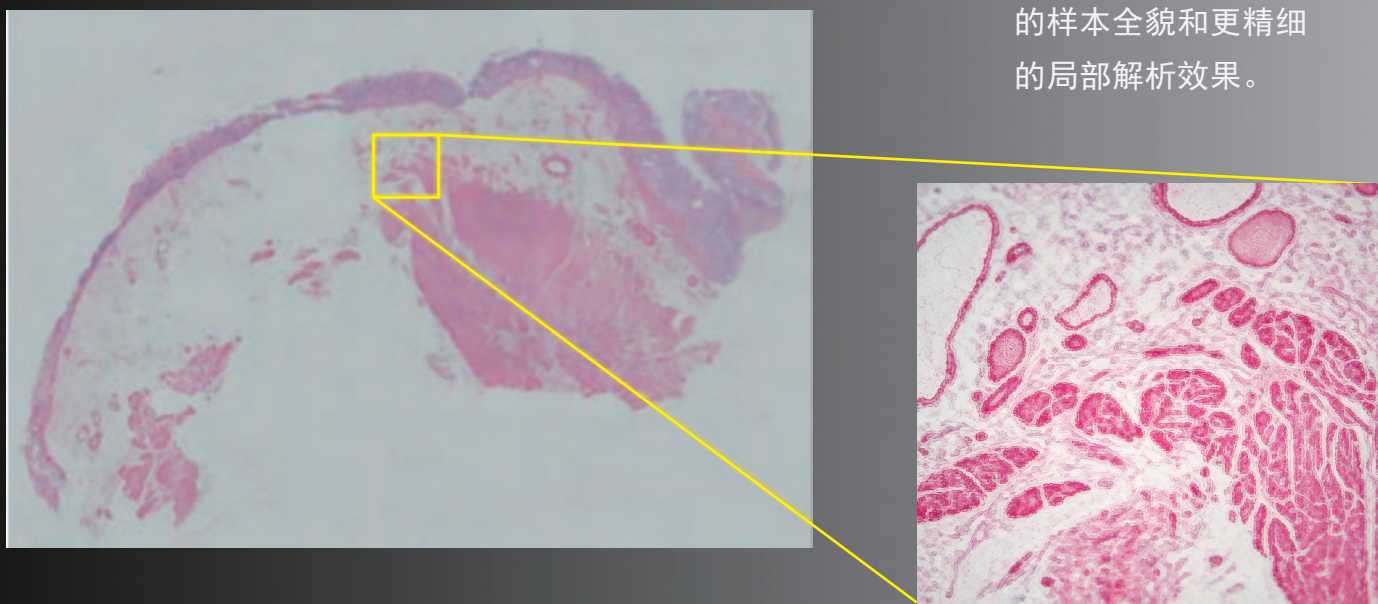
参数	生命科学物镜(生物荧光)	半导体检测物镜(晶圆量测)
放大倍率	4×、10×、20×、40×、60×、100×	2.5×、5×、10×、20×、50×、100×
典型 NA 范围	0.13~1.40	0.10~0.95
10× 典型 WD	3.5~8mm	25~40mm(LWD 长工作距)
50× 典型 WD	0.8~1.2mm	6~12mm(长 WD)
100× 典型 WD	0.13~0.25mm(油浸)	1~8mm(干式半导体)
远心类型	远心镜头	远心镜头
色差等级	Plan APO 复消色差、Fluor 荧光半复消	半/全复消色差
盖玻片校正	必须校正 0.17mm 盖玻片	无盖玻片, 表面直接观测
景深	极小	中等偏大
分辨率优先级	最高	最高、中等(长工作距离)
观察方式	明场、透射暗场、偏光、荧光、相差、透射DIC	明场、反射暗场、MIX明暗场混合、偏光、荧光、相差、反射DIC、红外
自动设备适配	极强,适配机械手等搭配	极强,适配机械手等搭配

大视野拼接 大样本观察更完整

面向大尺寸样品、超大范围成像与高像素建档的拼接能力

针对大尺寸样品、复杂结构样本及需要整图建档的场景，系统支持大范围显微拼接与高像素图像输出，可兼顾整体结构呈现与局部细节回看，适用于平板显示、PCB、半导体、大面积工业样件等应用方向。

通过拼接与瓦片式图像组织能力，可让用户同时获得更完整的样本全貌和更精细的局部解析效果。



最大**400x300mm**显微拼接

实现业内突破

可用于FPD平板显示领域
及PCB印刷线路板的大图拼接

独创瓦片技术

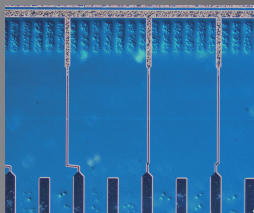
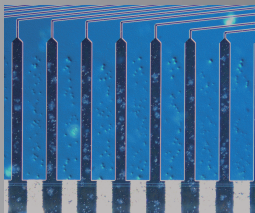
最大拼接像素>**200000*200000**, 高于业内同行

从金相分析到三维测量 拓展更深层的应用价值

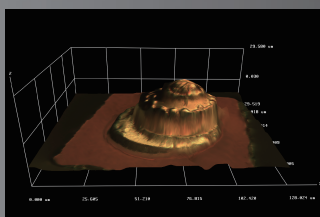
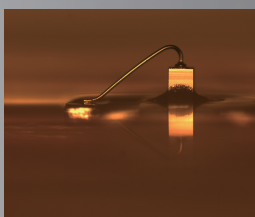
覆盖材料研究、微分干涉观察与三维分析的复合能力



系统不仅适用于常规金相分析和材料研究，还可进一步扩展至微分干涉观察、白光干涉辅助检查及三维测量等更深层应用。对于材料学研究、金属冶金、半导体封装及精密器件检测等场景而言，一套系统即可覆盖从组织观察、表面细节呈现到三维形貌辅助分析的多样化任务，进一步提升平台的应用深度与综合价值。



微分干涉DIC效果, 搭配白光干涉显微镜用于玻璃、晶圆的快速粗糙度定性检查、FPD面板显示的导电粒子检测, 最大可支持120英寸电视面板。

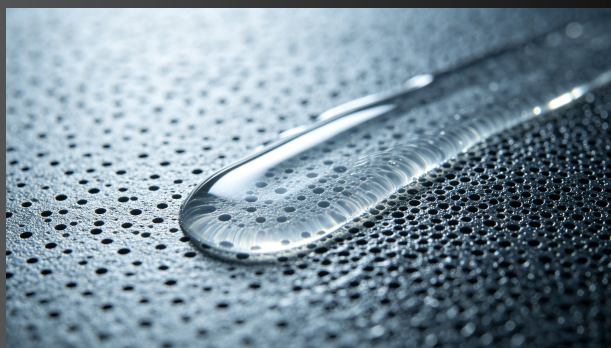


3D分析成像功能, 用于半导体封装wire bonding

显微镜微观检测：

防爆液注入电芯后，电极 / 隔膜 / 界面的微观行为（实际防爆效果）宏观合格 $\neq$ 微观合格，微观不合格依然会起火爆炸。

显微镜是验证防爆液实际防爆效果的必要检测手段，只测宏观理化参数（闪点、阻燃）是不够的。防爆液的优劣，不能只测闪点、阻燃、水分，必须用显微镜观察微观界面反应来判断。



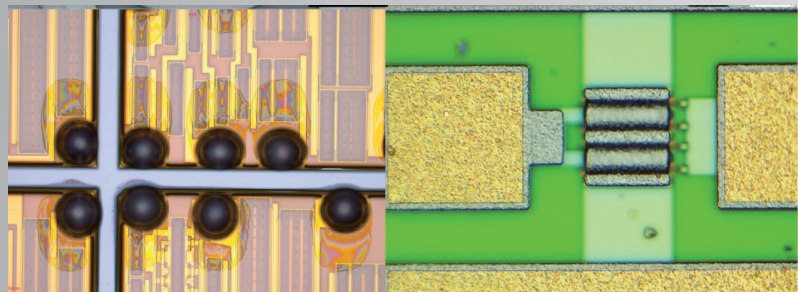


智能集成 稳定成像 适配更多观察需求

SLX全域集成显微系统 围绕“精准观察、高效操作与多场景适配”进行系统化设计，将智能倍率同步、亮度自动记忆、高稳一体机身、专业柯拉照明、透反双模结构以及人体工学操作体验整合于同一平台之中。

融合编码同步、亮度记忆、专业照明、透反双模与人体工学设计的多功能显微平台

均匀专业照明 细节分毫毕现



落射照明器采用柯拉照明系统，带视场光阑与孔径光阑，并预设起偏镜、检偏镜及滤色片插槽，可满足明场观察及简易偏光观察需求。照明均匀、杂散光控制更好，有利于提升图像层次感与细节识别能力。

透反双模设计, 一机多能适配

SLX全域集成显微系统采用透反两用机架设计，可满足反射观察与透射观察的多样化需求。机架可支持放置大于40mm样品，并可通过调节平台位置适应不同样品高度，为金属、薄片、半透明样品及部分特殊工件观察提供更多灵活性。



人体工学设计, 科研舒适随行

30°倾斜观察筒、50mm~75mm瞳距调节范围、单边视度调节以及低手位粗微同轴调焦机构，充分考虑了长时间显微作业中的舒适性与便利性，可有效减轻操作者疲劳，提高日常使用体验。



精密移动载物台

双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；
平台面积240X175mm，工作台面积：135X125mm，
玻璃台面：101X101mm，移动范围：75mmX50mm
可配反射用金属载物台板，透反两用玻璃载物台板。



安全限位机构



随机限位装置，可有效防止样品与印物镜碰撞，避免损伤。

机架通过旋转左图安全限位拨杆、可调节载物台最高限位位置、从而保护待测样品安全及设备镜头。



SALANG
赛慕朗



生物显微镜



专业偏光显微镜



红外显微镜



荧光显微镜



LIBS显微镜



拉曼显微镜



三维测量



金相显微镜

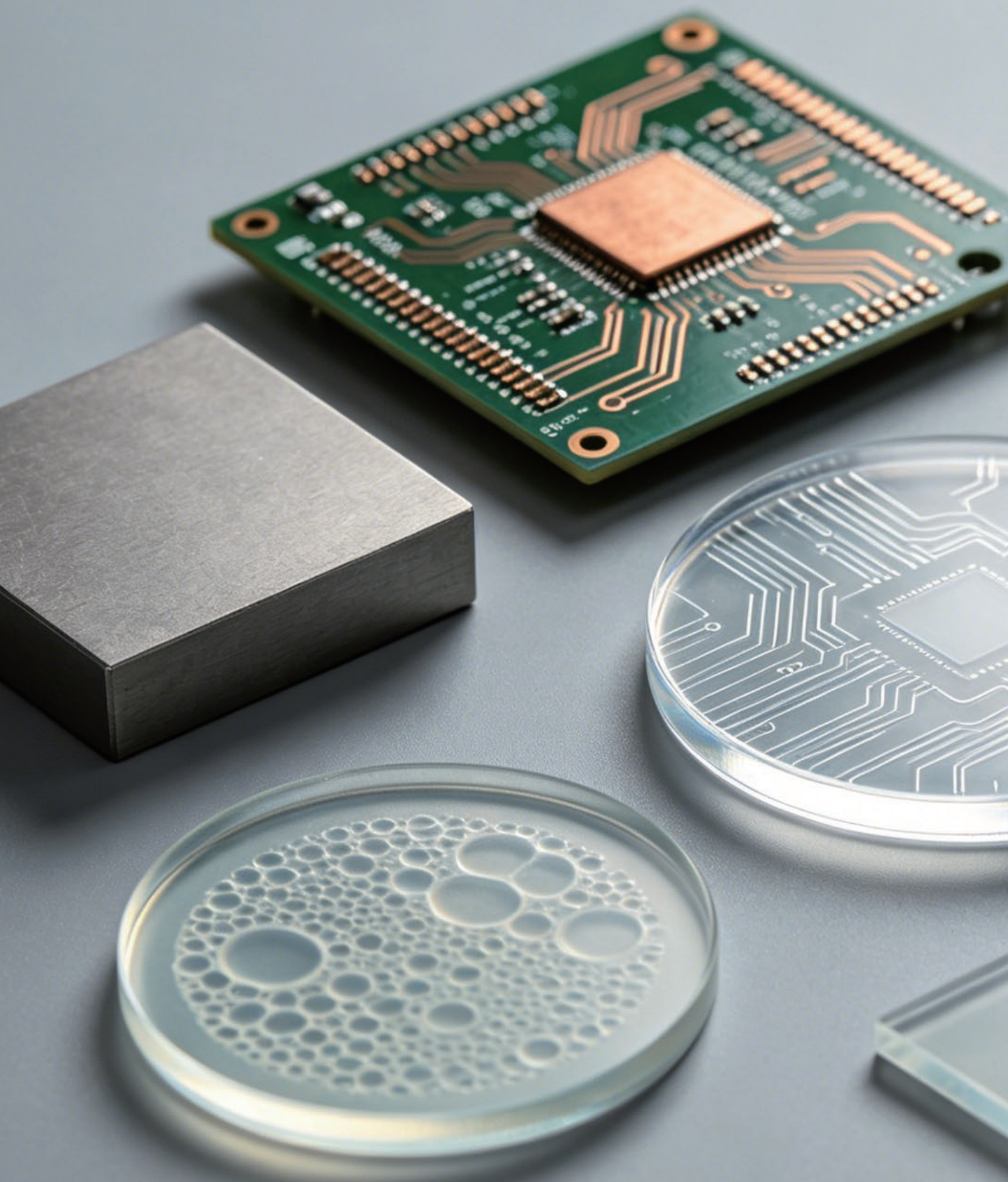


赛慕朗 SLX 超多维集成
显微分析系统

赛慕朗 SALANG SLX 系列

材料表征 · 失效分析 · 异物排查 · 镀层检测 · 颗粒分析

—— 全场景应用一站式完成 ——

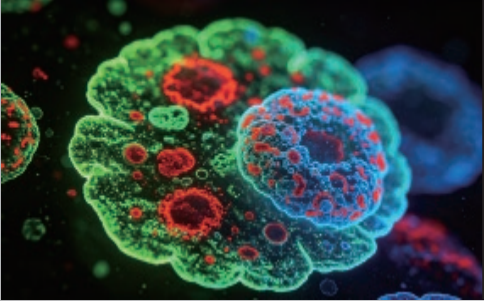


高度模块设计, 场景快速切换, 满足各行各业需求

集成明场、暗场、偏振、DIC、荧光、3D 形貌成像及全景瓦片扫描等多种观测模式于一体，
凭借强大的光学系统、高精度载台与智能化分析软件，实现一机多能、跨场景通用



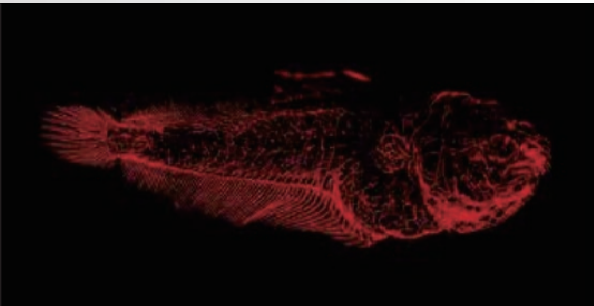
凭借高度模块化设计与灵活的配置扩展性，本设备无需频繁更换主机即可在不同行业、不同应用场景间快速切换，大幅提升使用效率与投资回报率，是科研实验室、品质检测中心、生产制程管控及教学实训平台的理想通用型显微分析仪器。



主要应用于生命科学研究
具备高灵敏度、高特异性、可定位、可动态观察
同时适用于细胞生物学、分子生物学、微生物学、神经科学
同时也可用于医学与临床诊断、材料科学，环境科学等领域

获得明亮的荧光信号

独立且同步的光路设计，一条用于荧光激发，两条用于观察。在任何变焦位置，SLX全域集成显微系统都能提供均匀且充分的视场照明。三束光路技术消除了观察路径中的反射干扰，实现成像时无噪声的纯黑色背景的强荧光信号。



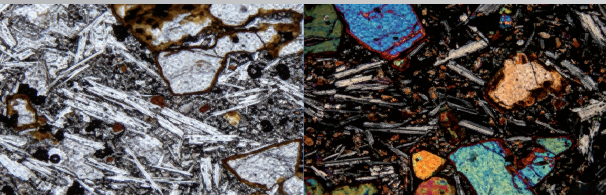
3D细节融合光路 (FusionOptics) 技术克服了传统体视显微镜的光学局限性。
兼具更高分辨率和更大景深 (DOF) 的优点，能够提供更高的图像亮度和更方便的三维成像。

极强的色彩成像, 超高的结构辨识度

具备起偏器 + 检偏器两套偏振片
可切换：单偏光、正交偏光、锥光干涉
能观察：消光位、延性、干涉色、光轴图

操作简单、稳定性强、维护成本低
无需复杂制样，不用腐蚀、不用喷金
光源耐用，适合实验室和产线抽检

可做透射 + 反射两用
透射式：地质薄片、药物晶体、薄膜、纤维
反射式：金属合金、矿石、硅片、涂层、半导体



含有黄长石晶体的高炉炉渣，根据其干涉颜色显示出明显的分带。干涉色从棕色 (边缘) 到蓝色 (核心) 的变化表明晶体生长过程中化学成分的变化 (降低镁含量)。

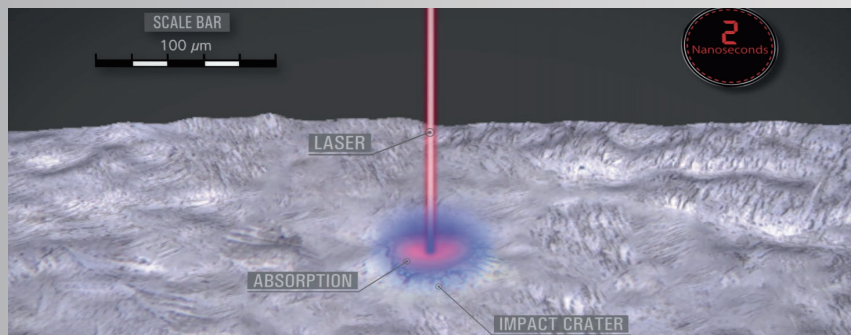
用偏振光识别双折射材料，能清晰呈现晶体结构、材料应力、分子取向和干涉色彩，
广泛用于地质、制药、液晶、高分子、半导体和玻璃行业，是普通光学显微镜无法替代的专业分析设备。

所见即所测 繁琐操作一键解决

无需制备和传输样品、无需系统调节、无需重新定位感兴趣区

多样化的领域适配能力

LIBS

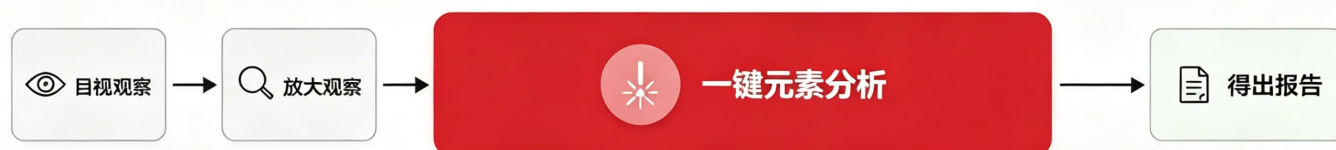


全新 配备 2合1系统

用于目视和化学分析目视和化学材料检验三合一，节省时间90%。

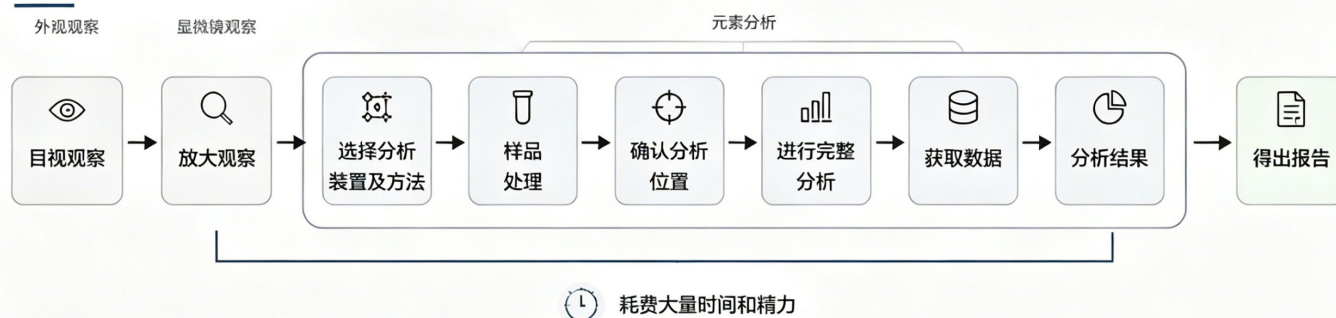
1秒即可获得化学指纹图谱，运用成熟的激光诱导击穿光谱技术进行即时元素分析，可在数秒内获得轰击点的化学信息。

优势：微镜观察+LIBS/二合一

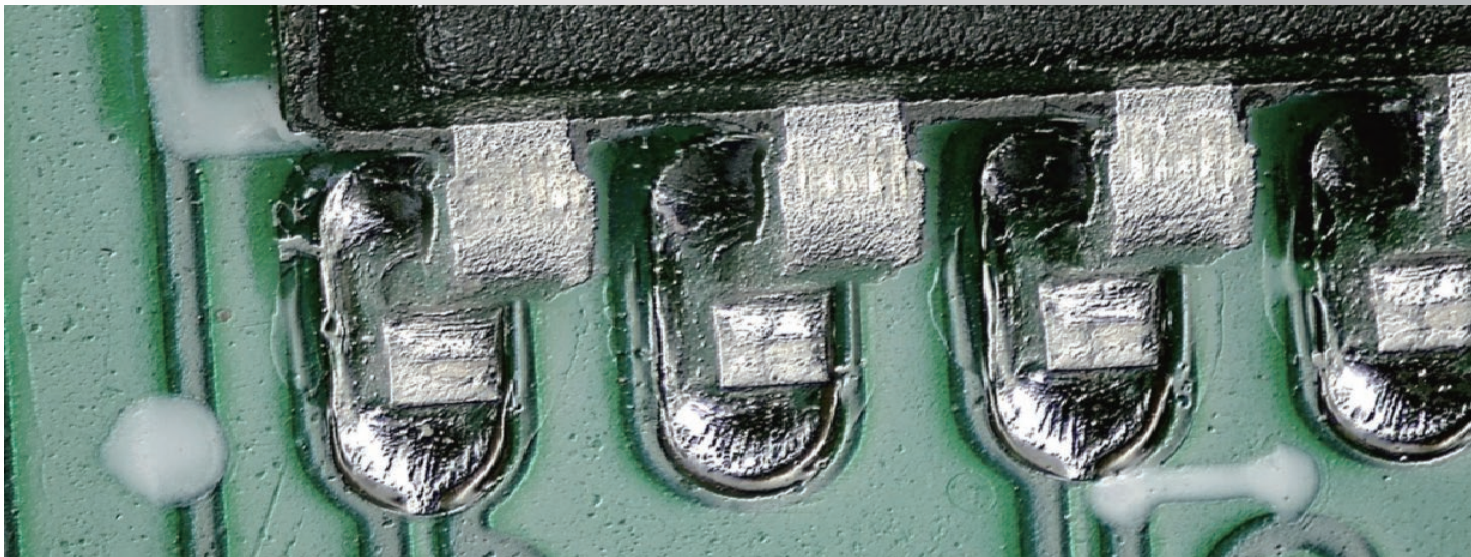


💡 相比传统电镜，赛慕朗LIBS在元素分析这一过程更加节省时间

传统元素分析解决方案：



无需对所需样品制备，找到感兴趣的位置，随后只需单击一下，即可触发LIBS分析。



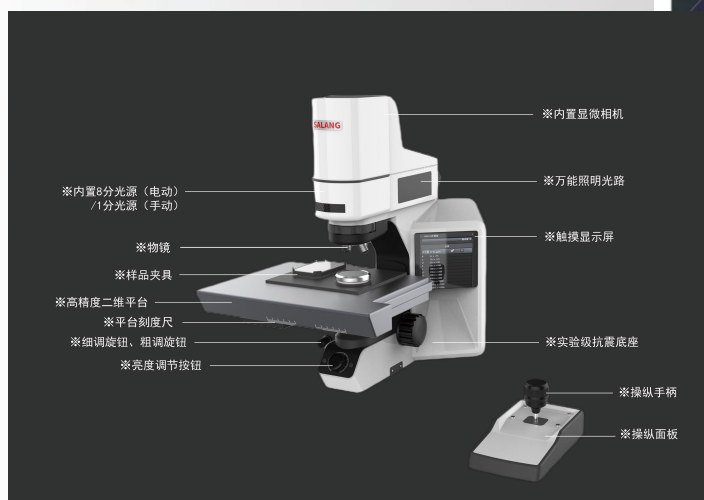
三维分析功能

典型应用领域：

精密模具、刀具行业、3C 电子、半导体封装
汽车零部件、压铸件、科研与教学样品观察
钟表、小五金、精密冲压件
广泛用于模具、刀具、电子封装、汽车零部件、注塑件的外观缺陷与尺寸检测

快速3D

无需上下调焦、大景深、全域清晰实现3D重建
介于普通金相显微镜和激光共聚焦之间

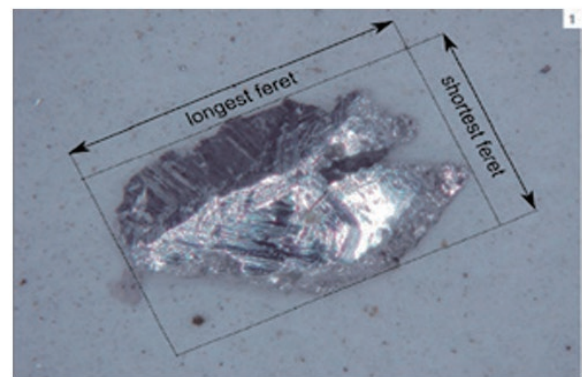


“大景深 + 快速3D”效果轻松呈现

汽车及新能源汽车是最大的应用市场，
主要是发动机、变速箱、液压阀体、喷油嘴清洁度检测；
曲轴、缸体、齿轮、轴承、紧固件清洁管控。

新能源：电池壳体、电机、电控、高压连接器、PCB
也广泛应用于航空航天与液压传动，3C 电子与半导体封装， 医疗器械与制药精密制造与通用机械。

颗粒的长度和宽度



零部件清洁度检测

（汽车、液压、航空、精密制造等）按照
ISO 16232、VDA19、ISO 4406、ISO 4407
等标准，对清洗过滤膜上的颗粒大小、数
量、形状的成分进行分析。

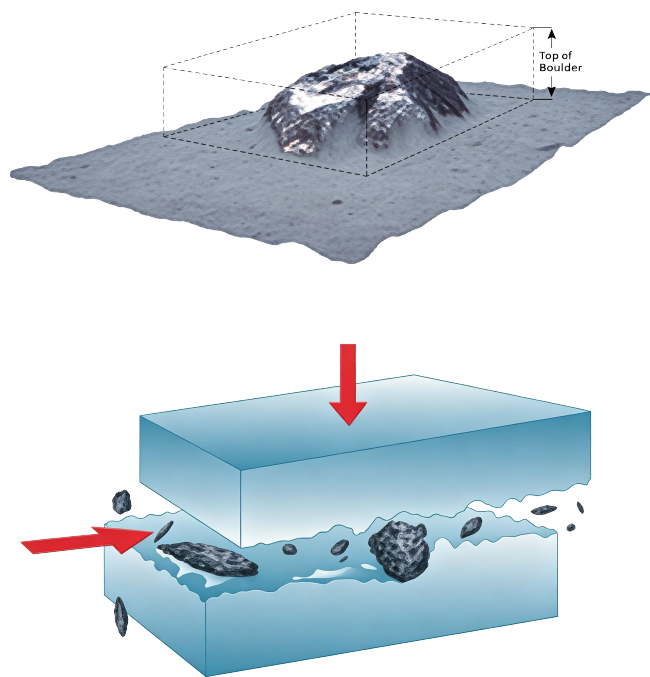
智能颗粒分析

落射明场

大景深

全自动扫描

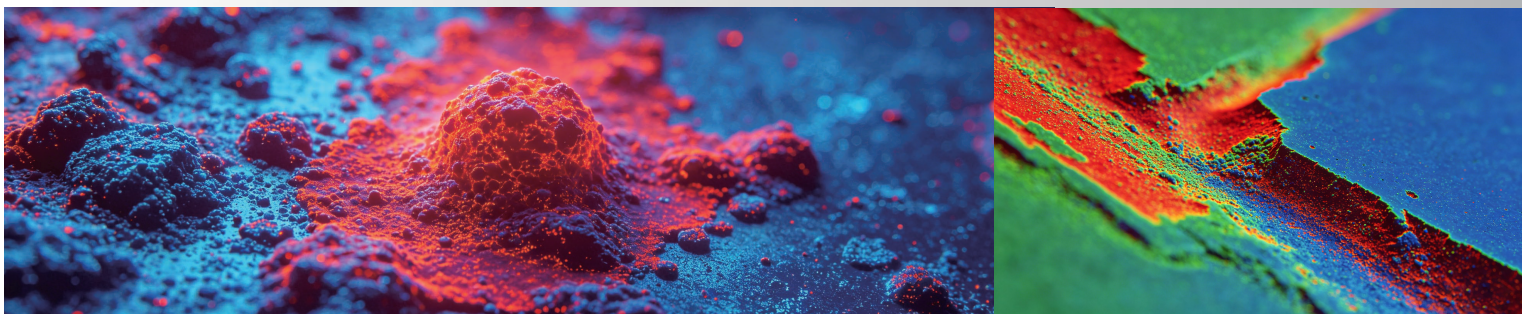
标准报告输出



全自动扫描载物台：

整张滤膜自动逐行扫描，无需人工逐视野观察。应用针对性极强，仅面向工业清洁度检测

红外显微镜



红外显微镜为 MEMS 提供“透视眼”

核心价值在于：

无损检测：无需开盖 / 减薄，保护昂贵 MEMS 结构。

深层可视：直达硅基内部，解决键合与封装痛点。

高效质控：适配晶圆级批量检测，降低良率损失。

精准定位 + 鉴定：成像找缺陷 + 光谱识成分，一站式完成微区分析。

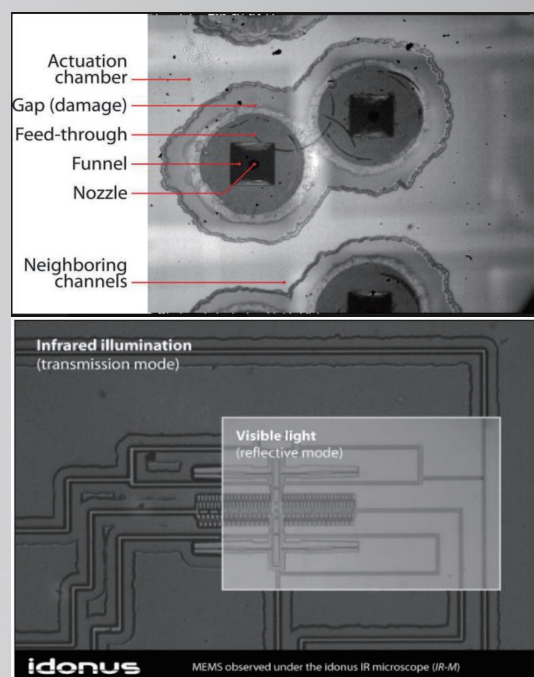
基于红外吸收光谱：

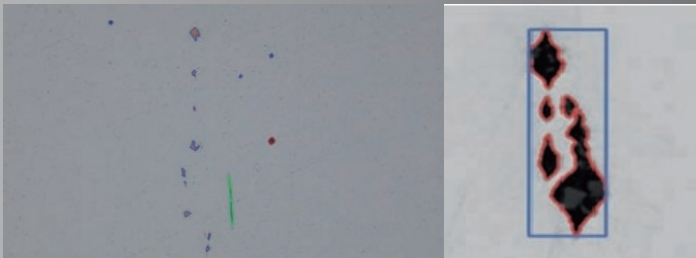
不同分子官能团（C=O、O-H、N-H、C=C 等）有特征吸收峰，形成“化学指纹”。

通过显微光路，将红外光聚焦到几微米甚至更小区域，对微小颗粒、异物、薄层进行单点检测或面扫描成像。可做透射、反射、ATR 模式，适应固体、粉末、薄膜、纤维等。



拉曼显微镜

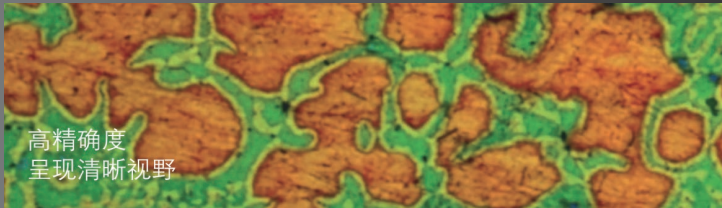




观察金属与合金的内部组织结构是材料、冶金、机械、汽车、模具、电子行业的“标配显微镜”。

金相显微镜主要用于观察金属、合金、陶瓷、半导体、复合材料等不透明固体材料的内部组织结构,是材料分析、失效分析、热处理质量控制的标准仪器。

主要应用于钢铁与冶金行业,汽车零部件行业,3C 电子、半导体封装、模具与刀具、表面处理行业,科研与质检机构。



物镜配置规格

以“场景需求”为导向，平衡性能、成本与操作便利性，同时注意设备兼容性和维护需求

明场物镜 SLX APO

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量(g)
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	
SLX APO 1X	1100010	0.025	13	200	11.0	440	24	9.6X12.8	240
SLX APO 2X	1100020	0.055	34	100	5.0	91	12	4.8X6.4	206
SLX APO 3.5X	1109350	0.1	41	57.14	2.8	28	6.9	2.7X3.6	218
SLX APO 5X	1100050	0.14	35	40	2.0	14	4.8	1.92X2.56	212
SLX APO 7.5X	1109750	0.21	34	26.67	1.3	6.2	3.6	1.28X1.7	247
SLX APO 10X	1100100	0.28	34	20	1.0	3.5	2.4	0.96X1.28	217
SLX APO 15X	1100150	0.35	22	13.33	0.8	2.2	1.8	0.64X0.85	240
SLX APO 20X	1100200	0.42	20	10	0.7	1.6	1.2	0.48X0.64	271
SLX APO 50X	1100500	0.55	13	4	0.5	0.9	0.48	0.19x0.26	298

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值。

明场物镜

SLX APH

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	(g)
SLX APH 5X	1200050	0.21	25	40	1.3	6.2	4.8	1.92x2.56	251
SLX APH 10X	1200100	0.42	15	20	0.7	1.6	2.4	0.96x1.28	382
SLX APH 20X	1200200	0.6	9.5	10	0.5	0.76	1.2	0.48x0.64	563
SLX APH 50X	1200500	0.75	5.2	4	0.4	0.5	0.48	0.19x0.26	338
SLX APH 100X	1200000	0.9	14	2	0.3	0.34	0.24	0.1x0.13	362

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明场物镜

SLX APL

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	(g)
SLX APL 20X	1300200	0.29	30	10	0.9	3.3	1.2	0.48X0.64	236
SLX APL 50X	1300500	0.42	20	4	0.7	1.6	0.48	0.19X0.26	286
SLX APL 100X	1301000	0.55	13	2	0.5	0.9	0.24	0.1X0.13	302

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

红外激光物镜

SLX APN / SLX APNH

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	(g)
SLX APN 20X	2100200	0.42	20	10	0.65	1.56	1.2	0.48X0.64	377
SLX APN 50X	2100500	0.55	13	4	0.50	0.91	0.48	0.19X0.26	394
SLX APNH 20X	2200200	0.6	9.5	10	0.46	0.76	1.2	0.48X0.64	563
SLX APNH i50X	2210500	0.67	10	4	0.41	0.61	0.48	0.19X0.26	470
SLX APNH 50X	2200500	0.75	4	4	0.37	0.49	0.48	0.19X0.26	582

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

液晶红外物镜

SLX LAPN

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	(g)
SLX LAPN 20X(t0)	2300201	0.4	20	10	0.7	1.7	1.2	0.48X0.64	260
SLX LAPN 20X (t0.7)	2300202	0.4	20	4	0.7	1.7	1.2	0.48X0.64	259
SLX LAPN 20X (t1.1)	2300203	0.4	20	10	0.7	1.7	1.2	0.48X0.64	258
SLX LAPN 50X (t0)	2300501	0.45	15	4	0.6	1.4	0.48	0.19X0.26	300
SLX LAPN 50X (t0.7)	2300502	0.45	15	4	0.6	1.4	0.48	0.19X0.26	299
SLX LAPN 50X (t1.1)	2300503	0.45	15	4	0.6	1.4	0.48	0.19X0.26	298

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

紫外物镜

SLX APU / SLX APUH

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	(g)
SLX APU 50X	3100500	0.42	17	10	0.65	1.56	1.2	0.48X0.64	268
SLX APUH 50X	3200500	0.65	10	4	0.42	0.65	0.48	0.19X0.26	405

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

液晶紫外物镜

SLX LAPU

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨力	物镜焦深	实际视场(mm)		重量
		NA	WD(mm)	f(mm)	R (μm)	±D.F(μm)	Φ24目镜	1"相机	(g)
SLX LAPU 20X (t0)	3300201	0.4	20	10	0.7	1.7	1.2	0.48X0.64	262
SLX LAPU 20X (t0.7)	3300202	0.4	20	10	0.7	1.7	1.2	0.48X0.64	261
SLX LAPU 20X (t1.1)	3300203	0.4	20	10	0.7	1.7	1.2	0.48X0.64	260
SLX LAPU 50X (t0)	3300501	0.45	15	4	0.6	1.4	0.48	0.19X0.26	295
SLX LAPU 50X (t0.7)	3300502	0.45	15	4	0.6	1.4	0.48	0.19X0.26	294
SLX LAPU 50X (t1.1)	3300503	0.45	15	4	0.6	1.4	0.48	0.19X0.26	293

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明场物镜

SLX FLU

品名	SLX FLU				
	5X	10X	20X	50X	100X
货号	1600050	1600100	1600200	1600500	1601000
光学系统特征	无限远校正				
观察方法	明场				
色差的校正水平	半复消色差				
放大倍率[X]	5	10	20	50	100
焦距[mm]	40	20	10	4	2
数值孔径(NA)	0.15	0.3	0.45	0.8	0.9
工作距离(WD)[mm]	20	11	3	1	1
物镜的视场数[mm]	25				
分辨率[μm]	1.8	0.9	0.6	0.34	0.31
焦深±D.F[μm]	12	3.1	1.4	0.43	0.34
齐焦距离[mm]	45				
螺纹	W4/5"X1/36"				
重量[g]	57	65	77	89	90

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明/暗场物镜

SLX FLD

品名	SLX FLD				
	5X	10X	20X	50X	100X
货号	1700050	1700100	1700200	1700500	1701000
光学系统特征	无限远校正				
观察方法	明场/暗场				
色差的校正水平	半复消色差				
放大倍率[X]	5	10	20	50	100
焦距[mm]	40	20	10	4	2
数值孔径(NA)	0.15	0.3	0.45	0.8	0.9
工作距离(WD)[mm]	20	11	3	1	1
物镜的视场数[mm]	25				
分辨率[μm]	1.8	0.9	0.6	0.34	0.31
焦深±D.F[μm]	12	3.1	1.4	0.43	0.34
齐焦距离[mm]	45				
螺纹	M26X0.706				
重量[g]	78	95	111	123	122

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明场长距离物镜

SLX FLU

品名	SLX FLU		
	L20X	L50X	L100X
货号	1620200	1620500	1621000
光学系统特征	无限远校正		
观察方法	明场		
色差的校正水平	半复消色差		
放大倍率[X]	20	50	100
焦距[mm]	10	4	2
数值孔径(NA)	0.4	0.5	0.8
工作距离(WD)[mm]	12	10.4	3.1
物镜的视场数[mm]	25		
分辨率[μm]	0.7	0.55	0.34
焦深±D.F[μm]	1.7	1.1	0.43
齐焦距离[mm]	45		
螺纹	W4/5"X1/36"		
重量[g]	65	68	88

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明/暗场长距离物镜

SLX FLD

品名	SLX FLD		
	L20X	L50X	L100X
货号	1720200	1720500	1721000
光学系统特征	无限远校正		
观察方法	明场/暗场		
色差的校正水平	半复消色差		
放大倍率[X]	20	50	100
焦距[mm]	10	4	2
数值孔径(NA)	0.4	0.5	0.8
工作距离(WD)[mm]	12	10.4	3.1
物镜的视场数[mm]	25		
分辨率[μm]	0.7	0.55	0.34
焦深±D.F[μm]	1.7	1.1	0.43
齐焦距离[mm]	45		
螺纹	M26X0.706		
重量[g]	96	100	118

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明场物镜

SLX CF

品名	SLX CF			
	5X	10X	20X	50X
货号	1800050	1800100	1800200	1800500
光学系统特征	无穷远校正			
观察方法	明场			
色差的校正水平	消色差			
放大倍率[X]	5	10	20	50
焦距[mm]	40	20	10	4
数值孔径(NA)	0.13	0.3	0.46	0.8
工作距离(WD)[mm]	22.5	16.4	3.1	0.55
物方视场[mm]	5	2.5	1.25	0.5
分辨率[μm]	2.12	0.92	0.60	0.34
物镜焦深±D.F[μm]	16.27	3.06	1.29	0.43
齐焦距离[mm]	45			
螺纹	W4/5"X1/36"			
重量[g]	65	83	119	134

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明场物镜

SLX FLU

品名	SLX FLU				
	S5X	S10X	S20X	S50X	S100X
货号	1630050	1630100	1630200	1630500	1630100
光学系统特征	无限远校正				
观察方法	明场				
色差的校正水平	半复消色差				
放大倍率[X]	5	10	20	50	100
焦距[mm]	40	20	10	4	2
数值孔径(NA)	0.15	0.3	0.45	0.8	0.9
工作距离(WD)[mm]	23.5	17	4.5	1	1
物镜的视场数[mm]	25				
分辨率[μm]	1.83	0.92	0.61	0.34	0.31
焦深±D.F[μm]	12.22	3.06	1.36	0.43	0.34
齐焦距离[mm]	60				
螺纹	M26X0.75				
重量[g]	115	119	159	173	183

*分辨力和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

生物物镜

SLX APB

品名	SLX APB	SLX APB	SLX APB	SLX APB	SLX APB
	2X	4X	10X	20X	U20X
货号	4100020	4100040	4100100	4100200	4140200
光学系统特征	无穷远校正				
观察方法	明场/荧光				
色差的校正水平	复消色差				
放大倍率[X]	2	4	10	20	20
焦距[mm]	100	50	20	10	10
物镜的视场数[mm]	25				
数值孔径(NA)	0.1	0.2	0.45	0.75	0.8
工作距离(WD)[mm]	8.5	20	4	0.6	0.86
盖玻片厚度[mm]	-	-	0.17	0.17	0.17
浸液	Air				
弹簧保护	/	/	/	√	√
齐焦距离[mm]	60.06				
螺纹	M25X0.75				
重量[g]	207	166	187	265	252

荧光生物物镜

SLX FLBD

品名	SLX FLBD	SLX FLBD	SLX FLBD	SLX FLBD	SLX FLBD
	4X	10X	20X	40X	60X
货号	4200040	4200100	4200200	4200400	4200600
光学系统特征	无穷远校正				
观察方法	明场/荧光				
色差的校正水平	半复消色差				
放大倍率[X]	4	10	20	40	60
焦距[mm]	50	20	10	5	3.3
物镜的视场数[mm]					
数值孔径(NA)	0.13	0.3	0.45	0.6	0.7
工作距离(WD)[mm]	16.5	14.5	7.7-8.9	2.3-3.3	1.6-2.3
盖玻片厚度[mm]	-	-	0-2	0-2	0-2
浸液	Air				
校正环	/	/	√	√	√
齐焦距离[mm]	60.41				
螺纹	M25X0.75				
重量[g]	142	158	321	303	259

荧光相衬生物物镜

SLX FLBP

品名	SLX FLBP	SLX FLBP	SLX FLBP	SLX FLBP	SLX FLBP
	L4X	A10X	A20X	B40X	B60X
货号	4320040	4350100	4350200	4360400	4360600
光学系统特征	无穷远校正				
观察方法	明场/荧光/相衬				
色差的校正水平	半复消色差				
放大倍率[X]	4	10	20	40	60
焦距[mm]	50	20	10	5	3.3
物镜的视场数[mm]					
数值孔径(NA)	0.13	0.3	0.45	0.6	0.7
工作距离(WD)[mm]	16.5	14.5	7.7-8.9	2.3-3.3	1.6-2.3
盖玻片厚度[mm]	-	-	0-2	0-2	0-2
浸液	Air				
校正环	/	/	√	√	√
齐焦距离[mm]	60.41				
螺纹	M25X0.75				
重量[g]	142	158	321	303	263

白光干涉物镜

SLX INT/IND

品名	SLX INT	SLX INT	SLX IND	SLX IND
	5X	10X	20X	50X
货号	5100050	5100100	5200200	5200500
光学系统特征	无穷远校正			
观察方法	明场			
色差的校正水平	消色差			
放大倍率[X]	5	10	20	50
焦距[mm]	40	20	10	4
数值孔径(NA)	0.15	0.3	0.4	0.55
工作距离(WD)[mm]	9.2	7.4	4.6	3.4
物镜的视场数[mm]	5	2.5	1.25	0.5
分辨率[μm]	1.83	0.92	0.69	0.5
物镜焦深±D.F[μm]	12.22	3.06	1.72	0.91
齐焦距离[mm]	45			
螺纹	WJ4/5"1/36"	W4/5"X1/36"		
重量[g]	112	113	177	185

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

白光干涉物镜

SLX IND

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨率	物镜焦深	实际视场 / mm	重量 /g
		NA	WD/mm	f/mm	R/μm	±D.F./μm		
SLX IND 10X	5200100	0.3	7.3	20	0.92	3.05	2.5	200
SLX IND 20X	5200200	0.4	4.6	10	0.69	1.72	1.25	208

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

明场物镜

SLX APE

品名	货号	数值孔径	工作距离	焦距	分辨率	物镜焦深	实际视场 / mm	重量 /g
		NA	WD/mm	f/mm	R/μm	±D.F./μm		
SLX APE 50X	1400500	0.95	0.35	4	0.35	0.3	0.5	147
SLX APE 100X	1401000	0.95	0.35	2	0.35	0.3	0.25	153

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

微型物镜

品名	微型物镜			
货号	定制			
光学系统	有限远共轭			
色差校正	半复消色差			
放大倍率	10X	7X	5X	3X
数值孔径	0.85	0.7	0.55	0.5
工作距离 (μm)	100	240	500	500
像距(mm)	0.8	0.8	1	1
共轭距离(mm)	9.1-15			
工作波段	435-650,920+/-10,1064+/-10, 1300+/-10nm			
浸液	盐水			
盖玻片厚度(mm)	0/0.1/0.17			
重量(g)	0.2-0.5			
直径(mm)	2.1-3.3			
长度(mm)	10-15			

*分辨率和物镜焦深是根据基准波长 λ =550nm计算得出的值.

可支持远程或在家使用

可在多个电脑使用的“公司授权”

赛慕朗 SALANG SLX系列采用公司授权制。可以在事业所内的各个电脑上安装软件。由此，相关人员都能共享数据，实现迅速的项目推进。此外还能远程使用，可支持在家办公或出差地以及酒店使用。



直销体制特有的支援体制

赛慕朗采用不借助经销商或代理店的直销体制。对于各种各样的咨询，拥有丰富专业知识、具备技术实力的技术销售人员和现场工程师都能迅速应对。用细致入微的售后服务助力贵公司。还在当地提供检查服务和校正服务，一旦出现故障，还会提供免费替代机。引进设备后可放心使用。



技术规格

光学系统	无限远色差校正光学系统
观察筒	30° 倾斜，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50mm~75mm，单边视度调节：-2/+8屈光度，两档分光比R:T=100: 0或50: 50
目镜	高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm（视度可调）
物镜	平场半复金相明场5X物镜NA0. 15, WD15
	平场半复金相明场10X物镜NA0. 30, WD8. 4
	平场半复金相明场20X物NA0. 45, WD3. 0
	平场半全复金相明场50X物镜NA0. 75, WD3. 0
	平场半复金相明场100X物镜NA0. 90, WD1. 0（选配）
编码型物镜转换器	高精度内定位5孔明场编码转换器，亮度记忆功能。编码型物镜转换器将显微镜的硬件设置与欧米特图像分析软件整合在一起。屏幕上显示物镜的放大倍率，同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准值，杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误。亮度记忆功能能够记忆在使用每个物镜时的照明亮度，当不同物镜相互转换时，自动对光强进行调节，减少视觉疲劳，提高工作效率。
粗微调焦机构	透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程30mm，微调精度0. 001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构，最大样品高度40mm。
载物台	双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积240X175mm，工作台面：135X125mm，玻璃台面：101X101mm，移动范围：75mmX50mm可配反射用金属载物台板，透反两用玻璃载物台板
上照明系统	自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz，反射灯室，单颗大功率10WLED，暖色，柯拉照明，带视场光阑与孔径光阑，中心可调，
下照明系统	自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz，透射灯室，单颗大功率10WLED，暖色
聚光镜	透射用摇出式消色差聚光镜（N. A0. 9），带可变孔径光阑，中心可调
其他附件	摄影摄像附件：1X、0. 65X、0. 5X C接口，可调焦；
	4K高清成像系统、USB3. 0电脑版成像系统
	高精度测微尺，格值0. 01mm



SALANG

赛慕朗（广东）精密技术有限公司

广州市南沙区南沙街银峰一街1号707室

电话：020 3908 6761

MAIL: into@salang.net

厦门市集美区后溪镇珩田路541号一楼

电话：020 3908 6761

发售详情，欢迎致电赛慕朗或咨询就近办事处

打开微信“扫一扫”



赛慕朗公众号



赛慕朗视频号

当天16点之前订货
当日出货！
*需满足当日出货条件

本书发行时的内容是经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是各公司的商标及注册商标。严禁擅自转载本目录。

The contents of this book at the time of publication have been researched and reviewed by our company. Any changes to the contents are subject to alteration without prior notice. The company names and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Unauthorized reproduction of this catalog is strictly prohibited.